マイクロ金型による微細転写加工技術に関する研究(第1報)

小松 利安・萩原 義人・石黒 輝雄・勝又 信行・佐野 正明・宮川 和幸 山田 博之^{*1}・西村 通喜^{*1}・吉田 善一^{*2}・寺田 信幸^{*2}

Study on Transcription Molding of Micro-pattern using Microdie (1st Report)

Toshiyasu KOMATSU, Yoshihito HAGIHARA, Teruo ISHIGURO, Nobuyuki KATSUMATA, Masaaki SANO, Wako MIYAGAWA, Hiroyuki YAMADA^{*1}, Michiyoshi NISHIMURA^{*1}, Yoshikazu YOSHIDA^{*2}and Nobuyuki TERADA^{*2}

要 約

マイクロ関連部品は、要求される加工精度が高いため、材料への直接加工により小ロット製造されている場合が多いが、製造コストが高くなるため、微細転写加工による量産化技術が注目されている.しかし、実用化にはまだ多くの課題が残っている.そこで、本研究では転写型のマイクロ加工や微細転写加工の各種要素技術について検討を行った.はじめに、転写型への適用を目的として耐熱性や耐薬品性に優れたグラッシーカーボンへのエキシマレーザ加工技術を検討した.その結果、レーザによるグラッシーカーボンへの微細加工の可能性を確認でき、基本的な加工条件を把握した.さらに、転写加工実験用簡易マイクロ金型を用いた転写性実験を行い、樹脂フィルムへの基本的な加工条件を確認した.

1. 緒 言

近年、マイクロテクノロジーは、様々な分野への応用 が期待されている.多くのマイクロ部品は、要求される 加工サイズや加工精度が高いため、各種微細加工機を用 いて小ロット加工により試作・製造が行われている場合 が多い.しかし、材料への直接加工では製造コストが高 くなり、今後は微細転写加工による量産化技術の必要性 が高まると考えられる.現在、半導体製造技術を応用し たマイクロ金型作製技術に関する研究、ホットエンボス 法やインプリント法などの転写加工技術に関する研究が 盛んに行われている.¹⁾⁻³⁾しかし、実用化にはまだ多 くの課題が残されている.例えば、転写加工用マイクロ 金型の作製に適した加工技術と材料の選定、マイクロ金 型の品質(耐久性、離型性など)の向上、材料に応じた転 写加工条件の最適化とタクトタイムの向上等があり、こ れらの課題を解決する必要がある.

本研究では、数十µmから数百µmのマイクロ形状 を有する部品の加工を主なターゲットとし、マイクロ金 型を作製するための加工技術や微細転写加工技術の検討 を行った.具体的には、耐熱性や耐薬品性等に優れてい るが、一般的に切削などの機械加工が難しいグラッシー カーボン(ガラス状炭素材料)に、ハーフトーンマスク を用いたレーザ加工を適用し、立体的な微細形状の基

- *1 山梨県富士工業技術センター
- *2 東洋大学工学部

本的な加工条件を把握した.また,微細転写加工技術を 検討するため,実験用簡易マイクロ金型を作製し,樹脂 フィルムへの基本的な加工実験を行った.

2. マイクロ加工技術の検討

2-1 実験方法

立体的な微細形状の作製を目的として、表面を鏡面研 磨加工したグラッシーカーボン(東海カーボン(㈱, GC-20SS)を用いて、レーザ加工実験を行った.レーザに は、アブレーション加工が可能でマイクロ加工に適した エキシマレーザ(Exitech 社, PS2000)を用いた.また、 フォトリソグラフィとアノード酸化処理によるアルミ薄 膜^{4),5)}を、レーザ加工用ハーフトーンマスクに応用す ることを試みた.そのアルミ薄膜形成プロセスを図1に 示す.一辺が約 200 µ m,高さが約 12 nm の四角錐に近 い形状のアルミ薄膜を光学石英ガラス板上に成膜し、そ のアルミ薄膜を用いてエキシマレーザの強度分布を変



図1 アルミ薄膜形成プロセス

化させ、グラッシーカーボンに立体的な微細形状を加工 することを検討した.表1に示す条件でレーザ加工を行った.

| 表1 | ハーフト | ーンマスクに | こよる | レーザ加工条件 |
|----|------|--------|-----|---------|
|----|------|--------|-----|---------|

| 基板 | 光学石英ガラス | | |
|---------|--|--|--|
| マスク材質 | アルミ薄膜 | | |
| マスク形状 | 四角錐(幅:200µm, 高さ:約12nm) | | |
| 縮小光学系倍率 | ×10(縮小倍率:1/10) | | |
| フルエンス | 5.0 J/cm ² | | |
| 照射パルス数 | 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 pluses | | |

2-2 結果

フルエンスを 5 J/cm² とした場合の、レーザ照射パル ス数と加工部高さとの関係を図2に、レーザ照射パルス 数が 30, 100 pulses の場合の、加工部を電子顕微鏡で観 察した結果を図3 (a), (b)に示す. 幅 20~30µm,高さ 50µm以下の複数の立体微細形状をグラッシーカーボン に加工することができた. 照射パルス数と加工部高さと の関係は 400pulses までは比例関係となるため、高さの 制御は可能と考えられる. しかし,400pulses 以上では、 加工底面が形成されず加工除去量が低下し、さらに立体 形状の先端部は選択的に加工されるため、微細形状の高 さが最大値 50µmになると推測される. また、ハーフ トーンマスクの投影パターンは四角形であるが、パルス 数が多い 100 pulses での加工形状は、円錐状になること が分かった.



図2 微細突起形状の高さとレーザ照射パルス数との関係



図3 ハーフトーンマスクを用いたレーザ加工例

3. 微細転写技術の検討

3-1 実験方法

次に、微細転写加工技術について検討を行った.今回 は、ポリカーボネートとポリアセタールの、樹脂フィル ム(30×15×0.3mm)を被加工材とし、型を加熱し加圧 力制御でプレスする、精密ホットプレス装置(新東工業 ㈱、CYPT-L)を用いて実験を行った.精密ホットプレ ス装置の主な仕様を表2に示す.本研究では、加圧力や 加熱温度が、転写性にどの程度影響を及ぼすか実験を行 った.また、加圧力の保持時間については、プログラム 制御により、数段階に分けて設定することが可能である が、本研究では次の値で一定とした.

保持時間 第1段階:240 sec, 第2段階:300 sec 冷却時間 300 sec

| 定盤寸法 | 150×150mm |
|----------|---------------|
| 動作ストローク | 100mm |
| 繰り返し停止精度 | $\pm 10\mu$ m |
| 最大加圧力 | 10kN |
| 加圧力制御精度 | ± 0.1 kN |
| 最大加熱温度 | 300°C |

表2 精密ホットプレス装置の主な仕様

本研究は、マイクロ流体デバイスなどで利用される微 小溝を有した部品を、転写加工によって作製することを 最終的な目標としている.ただし、複雑な微細形状に対 する転写加工実験を行う前に、まず、基礎的な形状を有 した金型で、転写性について検討する必要がある.そこ で、本研究では、直線状微小溝を転写加工する実験を 行った.図4に準備した転写加工実験用簡易マイクロ金 型の概略図を示す.微小溝の幅や深さを変化させて実験 するために、薄いステンレス板(SUS304H)を金属ブ ロックで挟み込み、1本の微小リブを形成させた.



図4 簡易マイクロ金型の概略図

転写加工した直線状微小溝は,非接触で表面形状を測 定することが可能な,コンフォーカル顕微鏡(レーザテ ック㈱, OPTELICS H1200)を用いて形状測定を行った. その測定装置全体を図5に,主な仕様を表3に示す. 微 小溝を転写加工した場合,加工条件によって,図6に示 すような,微小溝の端部にだれが発生する. その角度と 幅を測定し,転写加工のだれの評価を行った. 評価に用 いたコンフォーカル顕微鏡の対物レンズは 20 倍で一定 とした.



図5 コンフォーカル顕微鏡

表3 コンフォーカル顕微鏡の主な仕様

| 高さ 測定 | 測定範囲 | 8mm | |
|-----------|--------|------------------------|--|
| | 表示分解能 | 分解能 0.001 μ m | |
| | 再現性(σ) | 0.02 μ m | |
| 対物レンズ(倍率) | | 5 • 10 • 20 • 50 • 100 | |
| 光源 | | 白色キセノンランプ | |
| X-Y ステージ | | 150×150mm 電動ステージ | |



図6 微小溝形状の概略図

3-2 結果

最初に、転写加工実験に使用するポリカーボネートと ポリアセタールの熱特性について分析を行った. 7.0× 7.0×0.3mmの樹脂フィルムを, 7.0×7.0×3.0mmのアル ミナブロックで挟み込み, 0.3 Nの荷重をかけながら加 熱し、熱軟化点を分析した.分析装置は、熱機械的分析 装置(TA instruments 製, TMA 2940)を使用した.実 験結果を図7および図8に示す.ポリカーボネートの熱 軟化点は、約 200℃,ポリアセタールは、約 170℃であ った.



次に、転写性に関して、加圧力を変化させて実験した. 簡易マイクロ金型に使用したステンレス板の厚さと高さ を、約0.1mmに調整して微細リブを形成した. 被加工材 はポリカーボネートで、加熱温度は、一般的な熱変形温 度⁶⁾を参照して、140℃で一定とした. 端部だれ角度等 の実験結果を図9に示す. 微小溝の深さは全て0.1mm 前 後であったが、端部のだれは大きく発生した. また、加 圧力を増加させても、端部だれ角度と幅が多少減少する だけで、転写性は大きく向上しなかった.



図9 端部だれ角度と幅に対する加圧力の影響

さらに、簡易マイクロ金型の微小リブ寸法を変化させ て実験を行った.ステンレス板の厚さと微小リブの高さ を約 0.1mm と 0.05mm にして、それぞれの組み合わせに ついて実験を行った.被加工材はポリカーボネート、加 熱温度は 140℃、加圧力は約 0.2kN で一定とした.実験 結果を図 10 に示す.端部だれ角度の値は約 1/2 程度に 低下したが、端部だれ幅は殆ど変化せず、転写性を大き く向上させることはできなかった.



図10 端部だれ角度と幅に対する微小リブ寸法の影響

最後に加熱温度の影響について実験した. 微細リブの 厚さと高さは約0.1mmとした. 樹脂フィルムはポリカー ボネートとポリアセタールの2種類で,加圧力は一定の 約0.2kNで実験を行った. 図11に端部だれ角度と幅に 対する実験結果を示す. ポリカーボネートの場合は約 170℃,ポリアセタールの場合は約158℃付近になると, 端部だれ角度と幅は共に減少し,転写性が著しく向上す ることが分かった. 両樹脂フィルムとも,この温度より 低い場合は,端部だれの状態は殆ど変化せず,逆に高い 場合は,樹脂フィルムが軟化しすぎるため,微小溝が転 写できないことを確認した. また,前述した樹脂フィル ムの熱軟化点では,加熱しすぎであることも分かった. なお,ポリアセタールの場合,加熱温度が140℃以下で は,材料が殆ど軟化せず,微小リブ形状そのものが転写 されなかった.

4. 結 言

グラッシーカーボンを用いたマイクロ金型の作製,お よび1本の微小リブを形成させた,転写加工実験用の簡 易マイクロ金型を用いて,樹脂フィルムへの転写加工を 試みた.得られた結果は以下のとおりである.

 (1) アノード酸化処理によるアルミ薄膜を、エキシマレー ザレーザ加工用ハーフトーンマスクとして用いて、 複数の立体的な微細形状をグラッシーカーボンに加 工した.最大 50 µ mまでの高さが制御可能であっ た.



(2) 加圧や加熱温度等の条件が、転写性に及ぼす影響について実験を行った結果、加熱温度の影響が最も大きいことが分かった.ポリカーボネートの場合は、約170℃、ポリアセタールの場合は、約158℃付近になると転写性は著しく向上した.

参考文献

- 1) (社)高分子学会編:微細加工技術[応用編], ㈱エ ヌ・ティー・エス, P.147 (2003)
- 2) 早乙女康典:マイクロ塑性加工-マイクロ塑性加工技術の現状と展望-,精密工学会誌, Vol.69, No.9, P.1221 (2003)
- 前田龍太郎,他:ナノインプリントのはなし、日刊 工業新聞社,(2005)
- 4)勝又 信行,石田 正文,斎藤 修:フォトリソグ ラフィとアノード酸化を利用した AI 薄膜の表面加工, 表面技術, Vol.59, No.5, P.333 (2008)
- 5) 勝又 信行,石田 正文:3次元立体アルミニウム マスクを用いたシリコン基板の反応性イオンエッチ ング加工,J. Vac. Soc. Jpn., Vol.52, No.8, P.29 (2009)
- 6) 桜内雄二郎編:プラスチックポケットブック, ㈱工 業調査会, P.44 (1993)